

e-bülten

Vaksis Vakum Sistemleri Bülteni
Yıl: 2, Sayı: 5, Temmuz 2012

DEĞİŞİK UYGULAMALAR İÇİN PVD ve CVD KAPLAMA SİSTEMLERİ www.vaksis.com

2 altın öneri

yeni ürün
PVD-handy®/1M-sm

etkinlikler

- PVD: Physical Vapor Deposition
- CVD: Chemical Vapor Deposition

VAKSIS®

AR-GE VE MÜHENDİSLİK

Her Hakkı Saklıdır. © 2012

e-bülten

Vaksis Vakum Sistemleri Bülteni
Yıl: 2, Sayı: 5, Temmuz 2012

Vakum sistemleri kullananlar için

2 altın öneri!

1) Sisteminizde Azot ve/veya Argon gibi aslında zehirli olmayan fakat boğucu olan gazlar kullanıldığında, bu gazların sizin çalıştığınız ortamın (örneğin vakum kazanının içi) oksijenini azaltmadığından emin olun.

2) İnce film büyütme cihazını yerleştireceğiniz odanın iklimlendirilmesinin, ortamdaki toz oranının mümkün olduğu kadar düşük olmasının ve gürültü yapan (vakum pompası, su soğutma ünitesi ve hava kompresörü gibi) cihazların ve gaz silindirlerinin servis odası gibi ayrı bir odada konumlandırılmasının, kullanıcı sağlığı ve film kalitesi açısından iyi olduğunu unutmayın.

Önümüzdeki bültenlerde
altın önerilere devam edeceğiz...



Doç. Dr. Baybars ORAL
ŞİRKET MÜDÜRÜ

VAKSİS®

AR-GE VE MÜHENDİSLİK

Her Hakkı Saklıdır. © 2012

e-bülten

Vaksis Vakum Sistemleri Bülteni
Yıl: 2, Sayı: 5, Temmuz 2012

yeni ürün

PVD-*handy*[®]/1M-sm

handy serisi

1M: Bir adet magnetron saçtırma kaynağı

sm: Small

Manuel Kontrollü ve Düşük Bütçeler için Özel Tasarım Bir Kaynaklı Magnetron Saçtırma Sistemi

Düşük bütçelere yönelik tasarlanarak bu sistemde özellikle Nikel (Ni) gibi manyetik malzemeler saçtırılabilir.

KONTROL ve KULLANMA

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar kendi ön panolarından kontrol edilmektedir. Kazan üst kapağı açılarak hedef plaka değiştirilebilir ve alttaşa ulaşılabilir.

Sistem aşağıdaki özellikleri içermektedir.

Teknik Özellikler

Basınç Ölçümü: $<1 \times 10^{-5}$ Torr

(En Düşük Basınç: $< 3 \times 10^{-6}$ Torr)

Yüksek Hız Pompası: 70 lt/sn turbo pompa

Destek Pompası: 1 m³/sa kuru diyafram mekanik pompa

Alttaş Boyutu: Ø25 mm

Kaplama Metodu: Magnetron saçtırma kaynağı ile

Kaplama Yönü : Yukarıdan aşağıya doğru

Kaynak Sayısı: 1

Yükleme: Üstten

Kontrol: Manuel



VAKSIS[®]

AR-GE ve MÜHENDİSLİK

Her Hakkı Saklıdır. © 2012

e-bülten

Vaksis Vakum Sistemleri Bülteni
Yıl: 2, Sayı: 5, Temmuz 2012

etkinlikler

katıldıklarımız...

Yoğun Madde Fiziği Ege Bölgesi Toplantısı (6 Nisan 2012)

39. ICMCTF - Uluslararası Metalurjik Kaplamalar ve
İnce Filmler Konferansı, San Diego CA USA
(23-27 Nisan 2012)

ICSM 2012 Uluslararası Süperiletkenlik ve
Manyetizma Konferansı Kumburgaz-İstanbul
(29 Nisan – 4 Mayıs 2012)

8. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı
NANOTR-8, Hacettepe Üniversitesi-Ankara
(25 – 29 Haziran 2012)

katılacaklarımız...



27. Avrupa Fotovoltaik Güneş Enerjisi Konferans
ve Fuarı, Frankfurt- Almanya (25-28 Eylül 2012)

www.photovoltic-conference.com
www.photovoltic-exhibition.com



SOLARTR-2 Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı,
Antalya Dedeman (7-8 Kasım 2012)

<http://www.solartr.org/index.html>



Yayın Sahibi: Vaksis Ar-Ge ve Mühendislik Eğitim Danışmanlık Makine San.
Ve Tic. Ltd. Şti. adına Doç. Dr. Baybars Oral • Adres: Bilkent Üniversitesi
Merkez Kampüs Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberplaza, B-220
Bilkent 06800 ANKARA • Tel: 0 312 265 0146 • Fax: 0 312 265 0147 • 4 ayda bir
yayınlanır • Yayın türü: Bülten, Süreli • Elektronik ortamda dağıtılmaktadır .

VAKSIS®
AR-GE VE MÜHENDİSLİK

Her Hakkı Saklıdır. © 2012